

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-098113

(43)Date of publication of application : 07.04.2000

(51)Int.Cl.

G02B 5/10
G03F 7/20
H01L 21/027

(21)Application number : 10-268585

(71)Applicant : NIKON CORP

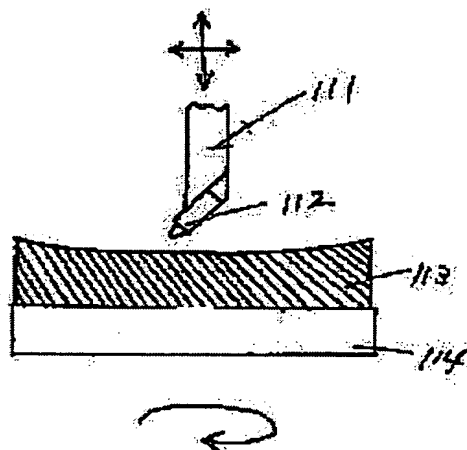
(22)Date of filing : 22.09.1998

(72)Inventor : SHIBATA NORIO
KIKUCHI TETSUO(54) PRODUCTION OF MULTIPLE LIGHT SOURCE FORMING REFLECTION MIRROR
AND OPTICAL DEVICE USING THIS REFLECTION MIRROR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve working efficiency by working a workpiece of ceramics so as to have a prescribed curvilinear surface and prescribed surface roughness or below, cutting out part of the formed prescribed curvilinear surface by straight working alone to obtain pseudo basic reflection surfaces and assembling a multiplicity thereof to prescribed conditions.

SOLUTION: A nickel block of the workpiece 113 is fixed to a rotary work holder 114 and the surface is finished to the prescribed curvilinear shape by a three-dimensionally precisely movable diamond tool 112. Next, the workpiece 113 is held to the work holder and is rotated and is polished by oscillating the oscillation shaft of a polisher stuck to a polishing tray, by which the reflection surface having the prescribed surface roughness or below is obtained. The pseudo reflection surface is cut out by a milling cup after the end of the polishing. The circular arc is divided and the circular arcuate portions are made linear, by which the five planes of the one element are made into plane and the long flank may be formed as a reference surface. The basic reflection mirrors are then assembled to the prescribed arrangement.



BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-98113

(P2000-98113A)

(43) 公開日 平成12年4月7日 (2000. 4. 7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 2 B 5/10		G 0 2 B 5/10	C 2 H 0 4 2
G 0 3 F 7/20	5 2 1	G 0 3 F 7/20	5 2 1 5 F 0 4 6
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 1 5 D
			5 1 7

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-268585

(22) 出願日 平成10年9月22日 (1998. 9. 22)

(71) 出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 柴田 規夫

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(72) 発明者 菊池 哲男

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

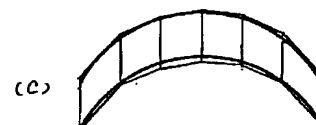
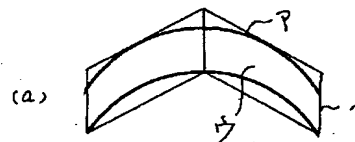
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多光源形成反射鏡の製造方法及び該反射鏡を用いた光学装置

(57) 【要約】

【解決すべき課題】 所定の面形状を繰り返し配列してなる、多光源形成反射鏡を製造する場合、所定の形状を有する基本反射鏡（要素反射素子）を個々に形成すると、曲線形状の加工に膨大な時間が掛かり、実用的ではなかった。それによって、スルーブットの良い、反射型の投影露光系を用いた半導体露光装置を実現することが出来なかった。本発明は、光利用効率の良い、多光源形成反射鏡を精度良く、安価に製造し、それによって、スルーブットの良い半導体露光装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 所定の面形状を直線で近似した形の反射鏡を作り、これを組み合わせることで、上記問題を解消した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】所定の曲面の一部を面形状とする基本反射面を繰り返し配置してなる多光源形成反射鏡の製造方法であって、該基本反射鏡の基材となる金属又は樹脂又はセラミックのブロックを被加工物として用意し、該被加工物を所定の曲面を有して且つ所定の表面粗さ以下になるように加工し、形成された所定の曲面の一部を直線加工のみによって切り出して疑似基本反射面を得、これを多数所定の条件に組み上げることの特徴とする多光源形成反射鏡の製造方法。

【請求項2】請求項1に記載の製造方法において、前記疑似基本反射面は基本反射面に外接する2つの折れ線を有することを特徴とする多光源形成反射鏡の製造方法。

【請求項3】請求項1又は2に記載の製造方法であって、前記2つの折れ線が同じ形状の折れ線であることを特徴とする多光源形成反射鏡の製造方法。

【請求項4】複数の反射鏡からなる反射型照明装置であって、請求項1～3のいずれかに記載の製造方法によって製造された多光源形成反射鏡を有することを特徴とする反射型照明装置。

【請求項5】光源、マスクを保持して移動するマスクステージ、該マスクを照明する照明装置、該マスク上のパターンをウェハ上に投影する投影光学装置、ウェハを保持して移動させるウェハステージを有する半導体露光装置であって、請求項4に記載の反射型照明装置を有し、該反射型照明装置の多光源形成反射鏡が有する基本反射面は前記投影光学装置の光学視野と相似形であることを特徴とする半導体露光装置。

【請求項6】請求項5記載の半導体露光装置であって、該投影光学装置が複数の反射鏡からなる反射型投影光学装置であり、かつ該投影光学装置の光学視野が円弧状であることを特徴とする半導体露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、反射鏡の製造方法及び半導体製造装置に関するものであり、特に、微小な基本反射面の繰り返し配列により構成される反射面を有する反射鏡の製造方法、反射型照明装置、更にはその照明装置を用いた半導体露光装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】現在、DRAMやMCP等の半導体デバイスの製造においては、最小線幅をより狭くする開発研究が盛んに行われており、デザインルール 0.13 μm (4 G・DRAM相当)、0.1 μm (16 G・DRAM相当)、更には0.07 μm (32 G・DRAM相当)の実現に向けて種々の技術が開発されている。この最小線幅の問題と切っても切れない関係を有するのが、露光時に生じる光の回折現象であり、これに起因する、像や集光点のボケが必要な最小線幅を実現する時の最大

の問題点である。この回折現象の影響を押さえるためには露光光学系の開口数 (N.A.: Numerical aperture) を大きくする必要があり、光学系の大口径化と波長の短波長化が開発のポイントになっている。ところが、光の波長が短くなると、特に 200 nm 以下になると、加工が容易で、光吸収の少ない光学材料が見当たらなくなってくる。そこで、透過光学系を捨てて、反射光学系による投影光学系の開発がなされており、相当な成果を上げている。その中に、複数の反射鏡の組み合わせによって、軟X線に対して円弧状の光学視野(露光領域として使用出来る領域)を実現し、マスクとウェハを投影縮小率比の相対速度で、互いに同期して移動させることによってチップ全体を露光しようとする方法がある。(例えば、Koichiro Hoh and Hiroshi Tanino; "Feasibility Study on the Extreme UV/Soft X-ray Projection-type Lithography", Bulletin of the Electrotechnical Laboratory Vol. 49, No.12, P.983-990, 1985、を参照

以後、参考文献1と記す)。ところで、最小線幅と並んで上記の様な半導体デバイス製造にとって重要な要素にいわゆるスループットがある。このスループットに關与する要因としては、光源の発光強度、照明系の効率、反射系に使用する反射鏡の反射率、ウェハ上の感光材料・レジストの感度等がある。現在、光源としては、ArFレーザー、F2レーザー、更に短波長光の光源としてシンクロトロン放射光やレーザープラズマ光が開発されており、反射鏡に関しても、反射率を上げる多層膜からなる反射鏡の開発も急ピッチで行われ、実用化のレベルに近い(詳細は前述の参考文献1、及び、Andrew M. Hawryluk et al; "Soft x-ray beamsplitters and highly dispersive multilayer mirrors for use as soft x-ray laser cavity component", SPIE Vol. 688

Multilayer Structure and Laboratory X-ray Laser Research (1986) P.81-90 及び、特開昭 63-312640を参照。以後、参考文献2と記す)。さて、照明系の技術開発であるが、要求される、一様照明性や開口数を実現する技術に関しては、例えば特開昭60-232552号公報に矩形形状の照明領域を対象とした技術が提案されている。しかし、上記投影系の様に投影光学系の視野が円弧上である場合、照明視野が矩形形状では光の利用効率が悪く、どうしても露光時間を短縮出来ず、従って、スループットが上がらなかった。最近、この問題を解決する方法として、投影光学系の有する光学視野に合わせて照明視野を設定し、これによって照明効率を上げ、スループットの問題を解決する方法が特願平10-047400に提案されている。この技術を図7を基に簡単に説明する。図7は投影露光装置の概要図であり、光源1より出た光は提案になる多光源形成反射鏡2、コンデンサー光学素子3及び反射鏡4を経てマスクステージ5上に保持されたマスク5を照明する。マスク5には、ウェハステージ7上に保持されたウェ

ハ上に描くべきパターンが反射体図形として形成されている。マスク上のパターンは2、3、4からなる反射型照明光学装置によって照明され、6a、6b、6c、6dからなる投影光学装置6を通じてウェハ7上に投影される。この時投影光学装置の光学視野は製作すべきデバイスチップ全体をカバー出来るほど広くはなく、マスク5とウェハ7を同期させて相対的に移動（スキャン）させながら露光を行うことによってチップ全体のパターンをウェハ上に形成する。このために、ステージの移動量を制御する、レーザー干渉距離計を含むマスクステージコントローラ8とウェハステージコントローラ9が備わっている。（このスキャンを伴う露光方式に関しては先の参考文献1を参照）。この際のポイントは、多光源形成反射鏡2をひとつ又は複数の微小な基本反射面の繰り返し配列により反射鏡を構成することであり、その基本反射面の外形状を投影光学装置の光学視野形状と相似形にすることである。これによって位置P2に多数の点光源像1がほぼ円形状に形成され、これがコンデンサー光学素子によって必要な照明視野を形成する。上記のような技術を用いると、マスク上の照明すべき領域を無駄なく一様に照明出来、露光時間の短縮が可能になって、高いスループットを有する半導体露光装置の実現が可能になる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記の様な、円弧状の照明視野を有する反射型照明光学装置用の多光源形成反射鏡、及びその基本反射面を実際に設計した結果を図8、9を用いて説明する。図8（a）に示すように、この多光源形成鏡は、3種類の基本反射面（A1、B1、C1）から構成されている。すなわち、図8（a）の多光源形成反射鏡の各列は、各基本反射面がA1、B1、C1、…の順に配列されている。図9（a）、（b）、（c）には、各基本反射面の形状を示す。これらの図に示すように各基本反射面は、曲率半径Rの凹の球面41に、図8（b）に示すようなYZ面に平行な円弧状帯（平均半径がZhの円の円弧状帯）を投影した形状になっている。この時投影する円弧の円の中心を球面の中心軸に合わせた場合の投影像がA1であり、円弧の中心を球面の軸に垂直にYhだけずらせた場合の投影像がB1、C1である。この投影像形状を切り出して基本反射面とする。いずれも、ほぼ円弧状になる。少なくともX方向より見れば完全な円弧状である。そしてB1、C1をそれぞれY軸方向に平行移動してA1と組み合わせていく。このようにして出来た反射鏡に例えばX方向より平行光線を入射させるとA1による点像が球面41の焦点に、B1による点像が焦点よりYhだけ横ずれて、C1による点像が焦点より-Yhだけ横ずれて形成される。ここで、例えば、基本反射面の、好適な実用的な設計解としては、凹球面の曲率半径Rは160～200mm、Zhは4.5～5.5mm、円弧の幅（円弧状帯

の幅）は0.3～2mm、円弧の長さは4.5～5.5mm、Yhは約2.3～2.7mmとなり、更に表面粗さが $R_{rms} < 0.3nm$ である。

【0004】ところで、この様な多光源形成反射鏡を加工する場合、その表面粗さの観点や面形状の加工精度から考えて、まず、被加工物を第1の所定の曲面に仕上げておき、その曲面の所定の位置より基本反射面を切り出している。例えば、基板用の被加工物に、アルミ合金を用い、図1に示すように、被加工物113をワークホルダ114に保持して回転させ、バイトホルダ111によって保持されたダイヤモンドバイト112を使ったNC切削加工機により第1の所定の曲面に形状創成する。この後加工面を図2に示すように、被加工物をワークホルダ115に保持して回転させ、研磨皿116に貼り付けられたポリシャ117を揺動軸を揺動させて研磨することによって必要となる表面粗さ $R_{rms} < 0.3nm$ を満足させる。次に、本被加工物の一部を図8に示すようなワイヤ放電加工機により切り出し、これを張り合わせることによって、図6のような複雑な形状を基本反射面を有する多光源形成反射鏡を加工することができる。しかしながら、このように材料としてアルミニウムのような、切削が容易な金属材料を使用して加工しても、ワイヤ放電加工機によって、その曲面より所定の円弧状の反射要素素子を切り出すには膨大な時間が掛かり加工コストが莫大になる。

【0005】そこで、本発明はこのような課題を解決するべく考案したものであり、設計通りの反射面形状を有する多光源形成反射鏡を歩留まり良く製造できる製造方法を提供することを第1の目的にし、更には、よりスループットの高い半導体露光装置を得ることを第2の目的にしている。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明では、第1の手段として、所定の曲面の一部を面形状とする基本反射面を繰り返し配置してなる多光源形成反射鏡を製造する場合、基本反射鏡の基材となる金属又は樹脂又はセラミックのブロックを被加工物として用意し、該被加工物を所定の曲面を有して且つ所定の表面粗さ以下になるように加工し、形成された所定の曲面の一部を直線加工のみによって切り出して疑似基本反射面を得、これを多数所定の条件に組み上げるようにした。これによって、切り出し加工に曲線部分がないので、加工効率が格段に良くなる。

【0007】第2の手段として、第1の手段を実施する際に、疑似基本反射面は基本反射面に外接する2つの折れ線を有するようにした。これによって、確実に必要な照明領域をカバー出来るようになる。第3の手段として、第1又は第2の手段を実施する際に、前記2つの折れ線が同一形状の折れ線であるようにした。これによって、組み合わせる際に互いに接する境界が共通の線分

になり、組み上げが容易になる。

【0008】第4の手段として、複数の反射鏡からなる反射型照明装置に上記第1～3のいずれかの手段によって製造された多光源形成反射鏡を有するようにした。これによって、反射型照明装置の光利用効率が良くなり、コストも低減される。第5の手段として、光源、マスクを保持して移動するマスクステージ、該マスクを照明する照明装置、該マスク上のパターンをウェハ上に投影する投影光学装置、ウェハを保持して移動させるウェハステージを有する半導体露光装置に、上記第4の手段で得

られた反射型照明装置を用い、その反射型照明装置の多光源形成反射鏡が有する基本反射面が前記投影光学装置の光学視野と相似形であるようにした。これによって、露光装置として、照明系と投影系の光学視野を合わせる事が出来、従って、光利用効率が各段に向上してスループットの高い半導体露光装置が得られる。

【0009】

【発明の実施の形態】上記の目的を達成するための本発明の基本的な考え方は、円弧状部分を直線にすることで、円弧形状を得るための数値制御機構の必要無しに、従来からの簡易な工作機械での、エッジ部分の加工や高い寸法精度の加工が容易になり、また、個々の光学素子の組立時の高精度化も可能になり、さらに、個々の光学素子の切り出しについても、基準が直線であるため、円弧状のものよりは、簡易により多くの素子を高精度に切り出すことが可能となる、といった知見に基づいている。

【0010】

【実施例】以下に、加工方法の実施例を示す。ここでは、基本反射面の、切り出すべき凹球面の曲率半径Rは180mm、Zhは5.0mm、円弧の幅(円弧状帯の幅)は1.0mm、円弧の長さは5.0mm、Yhは約2.5mmの場合を例にとる。基材用の材料としてはニッケルを用いている。図1のように、被加工物113のニッケルブロック(ワークという)を回転ワークホルダ114に固定し、3次元的に精密に移動可能な、バイトホルダ111に保持されたダイヤモンドバイト112によって、表面を所定の曲面形状に仕上げる。研削された表面を図2に示すように、被加工物113をワークホルダ115に保持して回転させ、研磨皿116に張り付けたポリシャ117を揺動軸118を揺動させて研磨することによって、所定の表面粗さ以下の反射面を得る。

研磨終了後、図3のように、フライスカッタ313によって、疑似基本反射面312が切り出される。尚、上記実施例では、折れ線として屈折部が1つであったが、図5のように屈折部を多く設けると、より基本反射面の形状に近づくが、加工の時間は長くなる。図5(a)は円弧を2分割し、(b)は4分割、(c)は6分割したものである。太線部分は、円弧を表している。このように、円弧部分を直線にすることで、一つの素子の5面が平面となり、長側面アを基準面にとることができ、底面と反射面うとの高精度加工も可能なる。また、長側面アと短側面イとの角度加工も簡単に高精度に作製する事ができる。さらに、個々の要素光学素子の切り出しについても、曲線加工時には最小でも2軸制御が必要であるが、本発明では1軸制御で済み、その分高精度化と材料の効率化ができる。この様に出来あがった基本反射鏡を所定の配置に組み上げると、図4のような疑似基本反射面を有する多光源形成反射鏡を加工することができる。これから解るように、各疑似基本反射鏡面の重ね合わせも直線のため、側面を研磨加工など高精度化が果たせ、合わせ精度も曲面時に比べ、1桁以上小さくすることができる。さらに、一括で加工に関しても、直線の集まりであれば、3軸制御で高精度化が図れる。

【0012】このように製作された基本反射鏡の組み上げは、図6(a)のように、基本反射鏡200の裏面に作りつけた調整用の部材(x1、y1、z1の基準面)201を同図(b)の多光源形成反射鏡基盤202に設けた基準部材(x2、y2、z2の基準面)203にはめ合わせることによって容易に行える。また、このように加工した面に対して、反射率を上げるために、F2レーザを光源に使用する時のために、アルミニウム薄膜を約100nmの厚さに蒸着によって形成し、さらにその上に同一真空層内にて酸化防止と反射率の維持の観点よりMgF2を数十nmの厚さに蒸着により形成した。また、軟X線領域の光(電磁波)を使用する時のためには、SiとMoの多層膜による反射鏡(前述の参考文献、1、2を参照)を形成した。

【0013】上記多光源形成反射鏡を半導体露光装置に組み込むには、図7のように構成すれば良い。以上のように本実施例では、球面の1部分である要素光学素子A1、B1、C1から構成される光学素子の加工方法を示した。しかし、本発明で加工できる光学素子はこれに限られない。たとえば、基本反射鏡の種類は、3種類よりも多くても、少なくとも良い。また、基本反射鏡は非球面の1部分であっても良い。

【0014】

【発明の効果】上述のように、本発明によって提供される加工方法により、多数の基本反射面からなる複雑形状の光学素子を高精度かつ高い加工効率で製造できる。また本製造方法により得られた光学素子は、半導体デバイス製造装置用の照明装置に好適である。

【図面の簡単な説明】

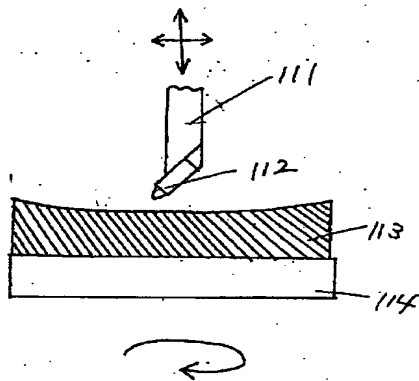
- 【図 1】本発明の実施例の研削図
 【図 2】本発明の実施例の研磨図
 【図 3】本発明の実施例の切り出し法
 【図 4】本発明に係る多光源形成反射鏡
 【図 5】本発明に係る疑似基本反射鏡
 【図 6】反射鏡の組み上げ調整部材
 【図 7】本発明に係る露光投影光学装置
 【図 8】本発明に係る多光源形成反射鏡
 【図 9】本発明に係る基本反射鏡の形状

【符号の説明】

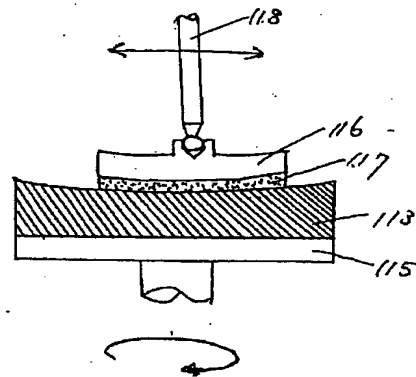
- 1 光源
 2 多光源形成反射鏡
 3 コンデンサー光学系
 4 反射鏡
 5 マスク、 5 s マ
 スクステージ
 6 投影光学装置
 7 ウェハ、 7 s
 ウェハステージ

- * 8 マスクステージコントローラ
 9 ウェハステージコントローラ
 41 基本反射面を切り出す母体となる凹
 球面
 111 バイトホルダ
 112 ダイヤモンドバイト
 113 被加工物
 114 ワークホルダ
 115 ワークホルダ
 10 116 研磨皿
 117 ポリシャ
 118 揺動軸
 200 基本反射鏡
 201 調整部材
 202 多光源形成反射鏡の基盤
 203 基準部材
 310 被加工物
 312 基本反射面
 313 フライスカッタ
 *20 A1、B1、C1・基本反射面

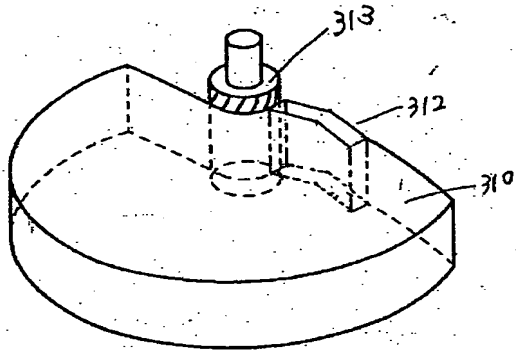
【図 1】



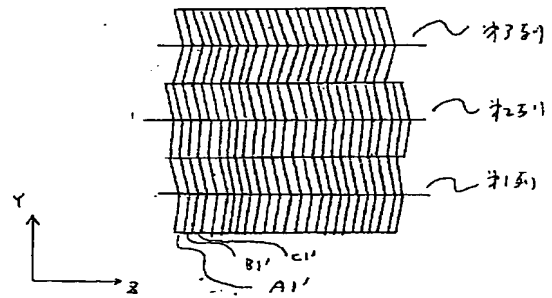
【図 2】



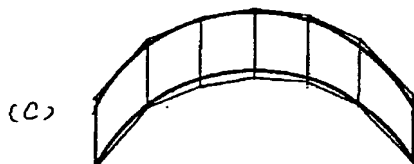
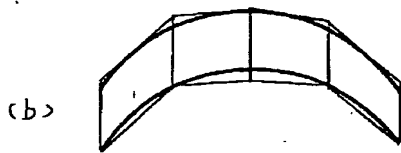
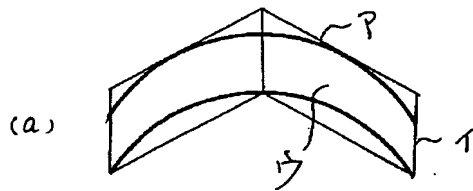
【図3】



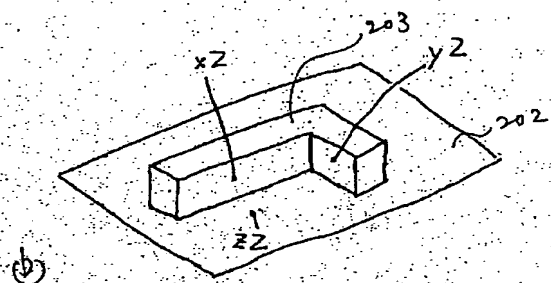
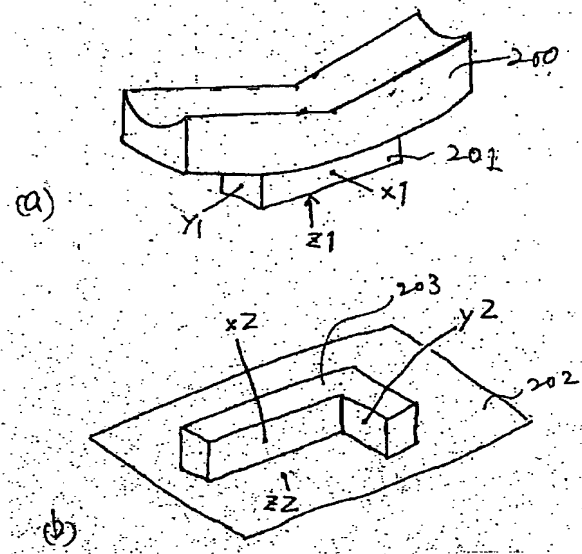
【図4】



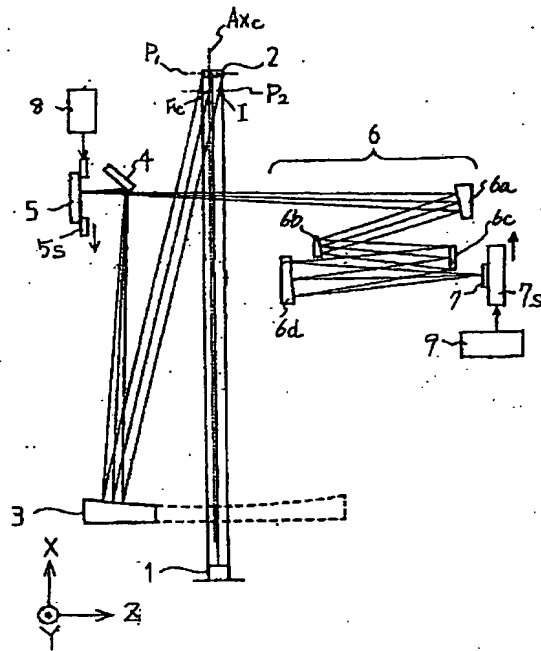
【図5】



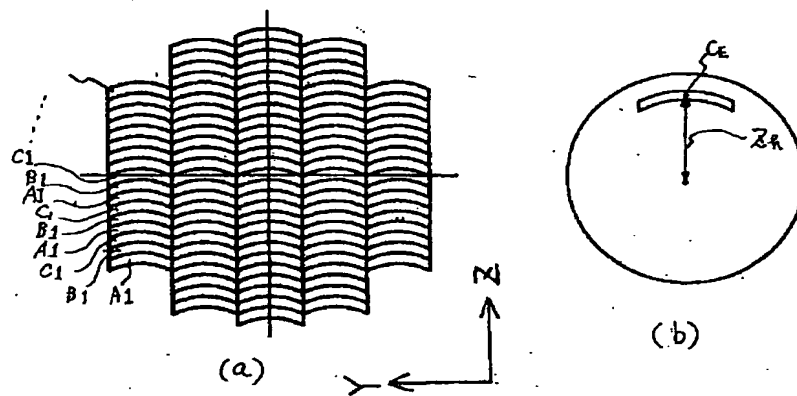
【図6】



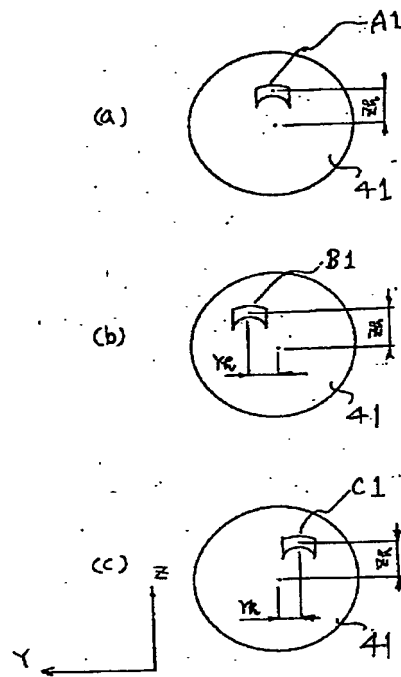
【図7】



【図8】



【図9】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H042 DA01 DA02 DA10 DA11 DA12
 DA18 DC09 DC10 DD01 DD05
 DD08 DE00
 5F046 AA05 AA07 AA08 BA05 CA04
 CA08 CB03 CB23 CB24 DB05
 DC05 DC12

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ ~~FADED~~ TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)